

Zum Thema / Dozenten

Hochauflösende analytische Verfahren sind sowohl für die Entwicklung und Einführung neuer Nano- und Dünnschichttechnologien als auch für die Integration neuartiger Materialien in High-Tech-Produkte entscheidend. Nanoanalytik wird zunehmend für die Prozess- und Materialcharakterisierung während der Fertigung von nanostrukturierten Systemen und Bauelementen sowie zur Beschreibung nanoskaliger Gefügebereiche in Werkstoffen erforderlich. Daher werden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf neue analytische Verfahren zur Untersuchung von dünnen Schichten und Nanostrukturen gerichtet. Applikations-spezifische Entwicklungen zeigen häufig, dass die Kombination mehrerer Analytik-Methoden notwendig bzw. sinnvoll ist, um die Entwicklung und Kontrolle von Prozessen in der Nanotechnologie bzw. die Sicherung von Performance und Zuverlässigkeit neuer Produkte zu gewährleisten.

Zahlreiche neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Nanoanalytik ermöglichen die Abbildung sowie die strukturelle und chemische Charakterisierung von Strukturen im Bereich < 100 nm, bis hin zu atomaren Dimensionen. Die Eignung eines Verfahrens für Forschung und Entwicklung oder zur Prozesskontrolle in der Fertigung wird durch die Methode selbst, insbesondere ob sie zerstörend oder zerstörungsfrei ist, sowie von der erforderlichen Mess- und Analysezeit („time-to-data“) bestimmt. Ausgehend von einer kurzen Einführung zur Nanoanalytik werden in diesem Kurs neue Verfahren zur Charakterisierung von dünnen Schichten, von Nanostrukturen und von Nanoteilchen erläutert. Dabei werden neue Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung vorgestellt

sowie applikationsspezifische Lösungen aufgezeigt. Die Herausforderungen an die Analytik im nm-Bereich, wie sie sich in der industriellen Fertigung zeigen, werden am Beispiel der Rasterelektronen- und Ionenstrahlmikroskopie vorgestellt. Spezielle Anwendungsbeispiele aus Mikro-, Nano- und Optoelektronik, Energietechnik und Leichtbau werden demonstriert, nanoanalytische Untersuchungen an metallischen, anorganisch-nichtmetallischen und organischen Werkstoffen besprochen. Die Referenten sind Fachleute, die sowohl aus Forschung und Lehre als auch aus der industriellen Praxis kommen.

Das Seminar wendet sich gleichermaßen an Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker in der Industrie, die in der Fertigung, Prozess- und Qualitätskontrolle sowie F&E tätig sind, aber auch an Mitarbeiter aus Forschungsinstituten und Hochschulangehörige, die sich mit neuen nanoanalytischen Verfahren vertraut machen wollen.

Das Fortbildungsseminar steht unter der fachlichen Leitung von **Prof. Dr. Ehrenfried Zschech**, Sprecher des Dresdner Fraunhofer-Clusters Nanoanalytik.

Weitere Dozenten sind:
Prof. Dr. Lukas Eng
TU Dresden, Institut für Angewandte Photophysik

Jörg Heber
Dr. Jan-Uwe Schmidt
Fraunhofer IPMS, Dresden

Dr. Kong Boon Yeap
Dr. Uwe Mühle
Fraunhofer IZFP, Dresden

Dr. Eckhard Langer
GLOBALFOUNDRIES, Dresden

Teilnehmerhinweise

Prof. Dr. Hannes Lichte
TU Dresden, Institut für Strukturphysik

Prof. Dr. Christian Pettenkofer
Helmholtz-Zentrum, Berlin

Dr. Annegret Potthoff
Fraunhofer IKTS, Dresden

Dr. Ahmed Shariq
Dr. Lutz Wilde
Fraunhofer CNT, Dresden

Das Fortbildungsseminar findet statt am Dresdner Fraunhofer-Cluster Nanoanalytik, c/o Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren, Maria-Reiche-Straße 2, Dresden.

Da der Teilnehmerkreis des Seminars begrenzt ist, erfolgt die Registrierung nach dem Eingangsdatum der Anmeldung. Die Teilnahmegebühr bitten wir erst nach Erhalt der Bestätigung unter Angabe des Namens des Teilnehmers und der kompletten Rechnungsnummer auf eines der INVENTUM GmbH Konten zu überweisen.

Informationen zur Zimmerbestellung erhalten Sie mit den Bestätigungsunterlagen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

INVENTUM GmbH
Niels Parusel
Senckenberganlage 10
D-60325 Frankfurt
Telefon: +49-(0)69-75306-757
Zentrale: +49-(0)69-75306-750
Telefax: +49-(0)69-75306-733
E-Mail: info@inventum.de
http://www.inventum.de

Teilnahmegebühr:
1.150,- EURO inkl. MwSt.

Teilnahmegebühr für DGM-Mitglieder:
Persönliche DGM-Mitglieder bzw. 1 Mitarbeiter eines DGM-Mitgliedsinstitutes / DGM-Mitgliedsunternehmens: 1.050,- EURO inkl. MwSt.

In der Teilnahmegebühr sind enthalten:

- Seminarunterlagen
- Pausengetränke
- Mittagessen
- ein gemeinsames Abendessen

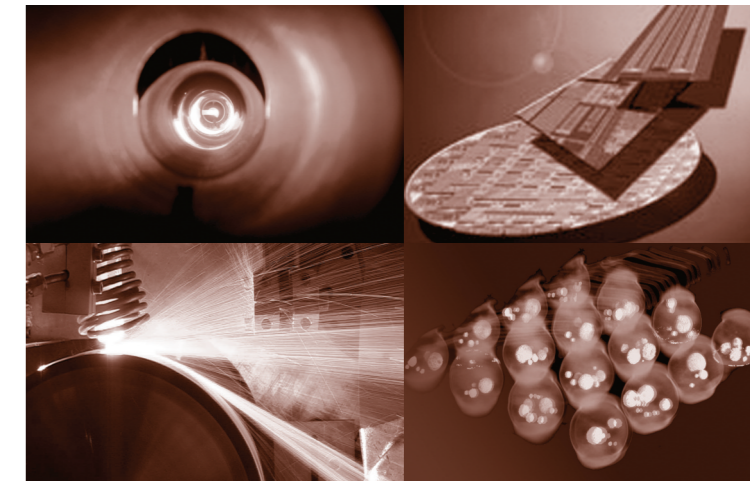
Teilnahmebedingungen:
Mit der Anmeldung werden die nachfolgenden Teilnahmebedingungen verbindlich anerkannt. Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Abmeldungen bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn beträgt die Bearbeitungsgebühr pauschal 100 Euro. Danach beträgt die Stornierungsgebühr 50% der Teilnahmegebühr. Die Stornierung muss 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn vorliegen, anderenfalls ist die volle Teilnahmegebühr zu zahlen. In diesem Fall senden wir die Veranstaltungsunterlagen auf Wunsch zu. Es ist möglich, nach Absprache einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Muss eine Veranstaltung aus unvorhersehbaren Gründen abgesagt werden, erfolgt eine sofortige Benachrichtigung. In diesem Fall besteht nur die Verpflichtung zur Rückerstattung der bereits gezahlten Teilnahmegebühr. In Ausnahmefällen behalten wir uns den Wechsel von Referenten und/oder Änderungen im Programmablauf vor. In jedem Fall beschränkt sich die Haftung der INVENTUM GmbH ausschließlich auf die Teilnahmegebühr.

NEU

DGM

Fortbildungsseminar

Nanoanalytik



29.-30. Nov. 2012

Dresden

Dresdner Fraunhofer-Cluster
Nanoanalytik

INVENTUM GmbH

www.nanoanalytik.fraunhofer.de
www.inventum.de

Seminarleitung

Prof. Dr.
Ehrenfried Zschech

Donnerstag

- 9:00 E. Zschech
Begrüßung und Einführung
Übersicht zu den Nanoanalytik-Verfahren
- 9:30 E. Langer
Rasterelektronen- und Ionenmikroskopie (Focused Ion Beam)
- Einführung in die Methoden der REM und FIB
 - Einsatz unter industriellen Bedingungen
 - Grenzen und Herausforderungen der Methoden
- 11:00 Kaffeepause
- 11:30 U. Mühle
Transmissionselektronenmikroskopie
- Abbildungsmethoden und Anwendungen
 - Gefügecharakterisierung in Nanobereichen
 - Hochaufgelöste Spannungsanalytik
- 12:30 Mittagspause
- 14:00 H. Lichte
TEM-Elektronenholographie
- Elektrische Nanofelder in Halbleitern: Dotierprofile
 - Mechanische Spannungsfelder in Halbleitern
 - Magnetische Nanofelder in magnetischen Filmen und Teilchen
 - Strukturen und Felder in atomaren Dimensionen
- 15:00 L. Eng
Atomkraftmikroskopie
- Höchstaufgelöste strukturelle Analyse von organisch/dielektrischen Grenzflächen
 - Trennung dielektrischer/magnetischer Informationen auf der nm-Längenskala
 - Quantitative Kelvin-Kraft-Mikroskopie und –Spektroskopie
 - Nanooptik im sichtbaren- und Infrarot-Wellenlängenbereich
- 16:00 Kaffeepause

Donnerstag

- 16:30 A. Potthoff
Charakterisierung von Nanopartikeln
- Dispergierung von Nanomaterialien (Aggregation, Agglomeration)
 - Partikelgrößenanalytik in Suspensionen – on-line und off-line
 - Chemische Charakterisierung von Partikeloberflächen
- 17:30 **Laborbesichtigung**
- 18:30 Ende des ersten Veranstaltungstages
- 19:30 Gemeinsames Abendessen

Freitag

- 9:00 J. Heber, J. U. Schmidt
Lichtoptische Oberflächen- und Dünnschichtanalytik
- Ellipsometrie
 - Weißlichtinterferometrie
 - Anwendungen für photonische Mikrosysteme
- 10:00 C. Pettenkofer
Photoelektronenspektroskopie
- Labor- und Synchrotronstrahlungsexperimente
 - Anwendungen in der Dünnschichttechnologie (Nanoelektronik, Photovoltaik)
 - Photoelektronenmikroskopie
- 11:00 Kaffeepause
- 11:30 L. Wilde
Röntgenstreuverfahren und -absorptionsspektroskopie
- Röntgenreflektometrie zur Dünnschichtcharakterisierung
 - Röntgenbeugung an ultradünnen Schichten
 - Röntgenabsorptionsspektroskopie an Nanopartikeln für die Katalyse

Freitag

- 12:30 Mittagspause
- 14:00 K. B. Yeap
Nanoindentation
- Härte und E-Modul von Nanostrukturen
 - Bruchzähigkeit und Adhäsion
 - Umgebungseinflüsse auf Schädigung und Bruch von dünnen Glasschichten
- 15:00 Kaffeepause
- 15:30 A. Shariq
Atomsondentomographie
- Methode und Auswertungsverfahren
 - Probenpräparation mit Focused Ion Beam
 - Anwendungen in der Nanoelektronik und Materialwissenschaft
- 16:30 E. Zschech
Abschlussbesprechung
- 17:30 Ende der Veranstaltung

Anmeldung

Nanoanalytik

29. - 30. November 2012
Fortbildungsseminar in Dresden

Mitgliedsnummer	<input type="checkbox"/> DGM-Mitglied
Geburtsstag	<input type="checkbox"/> Nichtmitglied
Telefon	<input type="checkbox"/> Ich interessiere mich für die Mitglied-
Telefax	<input type="checkbox"/> schaft in der DGM
E-Mail	
Titel / Vorname / Name (wie auf Zertifikat)	
Firma / Universität	
Abteilung / Institut	
Straße	
PLZ / Ort / Land	
Datum, Unterschrift	